

EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution for optical device manufacturing - January 19, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company’s most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. The EVG7300 system is offered as both a stand-alone tool as well as an integrated module in EVG’s HERCULES® NIL fully integrated UV-NIL track solution where additional pre-processing steps, such as cleaning, resist coating and baking or post-processing, can be added to optimize for particular process needs. The EVG7300 is a highly flexible platform that offers three different process modes (lens molding, lens stacking and SmartNIL nanoimprint) and support for substrate sizes ranging from 150-mm to 300-mm wafers.

TECHWORLD
 TECHWORLD ONLINE NEWS

특종 아카데미 뉴스 인사이트 오피니언

ATE (Automatic Test Equipment) 솔루션
 최고 품질의 테스트 장비 시스템 제조를 위한 솔루션

EV그룹, 광학기기 제조용 다기능 마이크로-나노임프린트 솔루션 출시

이제 UV 기반 공정을 단일 플랫폼에 통합

다기능 나노임프린트 기종 미세관라미네이션(SiO₂)과 나노, 기층, 195nm 제조용 웨이퍼 패턴, 레오그레의 광학 공구용 EV그룹(EVG)이 사용 가능한 SmartNIL 나노임프린트 웨이퍼 레벨 광학 시스템 EVG7300을 출시한다고 19일 밝혔다.



EVG7300은 나노임프린트, 레오그레의 렌즈 스태킹 플랫폼 같은 여러가지 처리(2D) 기반 프로세스를 단일 플랫폼에 결합했다. 이 나노 임프린트 시스템은 웨이퍼(150mm, 12"mm)와 나노(100nm, 1μm; 10"mm)를 195nm 웨이퍼를 위한 기층 레이어를 적용하는 신규 애플리케이션에 대한 연구개발(RD)과 생산 공정에 모두 사용될 수 있다. 이 애플리케이션 사례에는 웨이퍼 레벨 광학(VLO)과 광학 렌즈, 브로켄시, 차광 코팅, 중간 현상(IM) 레지스트 레이어(가이드, 레오) 제조, 렌즈 스태킹, 렌즈 웨이퍼 코팅, 광학사기 등이 있다. 최대 300mm 웨이퍼까지 처리하고 고품질 웨이퍼인 렌즈, 양방향 프로세스 제어, 우수한 수율 및 정밀도를 갖춘 EVG7300은 모든 자외선과 광원으로 마이크로 나노 광학 부품과 기기를 제조, 생산하는 사용자에게 적합하다.



EVG7300은 다양한 웨이퍼 크기의 EVG의 HERCULES UV-NIL, 웨이퍼 레벨 광학 시스템에 통합될 수 있다. EVG HERCULES UV-NIL, 웨이퍼 레벨 광학 시스템은 사용자의 특정 프로세스 요구에 따라 세팅과 레지스트 코팅, 웨이퍼 패턴 인지와 공구 패턴 수직에 대한 수정을 수월하게 한다.